

Ptfe 연속 반응 시스템 자켓형 정압 적하 깔때기 내부식성 Hf 내성 사용자 정의 가능

품목 번호: PL-CP20



소개

자켓형 정압 적하 깔때기가 장착된 프리미엄 PTFE 연속 반응 시스템을 만나보세요. 극한의 내부식성과 침전물 제로(Zero Precipitation)를 실현하도록 설계된 이 HF 내성 실험실 장치는 귀하의 특정 산업 연구 및 고순도 화학 프로세스 요구 사항을 충족하도록 완전히 사용자 정의할 수 있습니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 에칭 준비	웨이퍼 가공을 위한 HF 기반 에칭 용액의 준비 및 연속 혼합.	완벽한 HF 내성 및 제로 이온 오염.
제약 합성	고반응성 시약이 포함된 제약 중간체의 연속 흐름 생산.	불안정한 반응물을 위한 정밀 온도 제어.
미량 금속 분석	ICP-MS 및 기타 고감도 분석 방법을 위한 시료 분해 및 준비.	미량 원소의 용출이 없는 초순도.
정밀 화학 생산	일정한 시약 첨가 속도가 필요한 특수 화학물의 규모 확장 생산.	압력 평형 설계를 통한 일관된 유량.
배터리 소재 연구	부식성 환경에서 리튬 이온 배터리 전해질 및 양극재 전구체의 합성.	공격적인 전해질에 대한 장기 내구성.
중합 반응	온도에 민감한 중합 공정에서 촉매 또는 단량체의 제어된 첨가.	균일한 시약 투입 및 열적 안정성.
핵화학	산성 매체에서 방사성 동위원소의 취급 및 처리.	PTFE의 견고한 격리 및 방사선 저항성.

매개변수 범주	PL-CP20 사양 세부 정보	사용자 정의 상태
시스템 모델	PL-CP20 연속 흐름 시리즈	표준 식별자
주요 재료	고순도 PTFE, PFA, TFM	완전히 사용자 정의 가능
반응 용량	50mL ~ 20L 이상 확장 가능	프로젝트 요구 사항에 따름
깔때기 용량	25mL ~ 5000mL 자켓 옵션	프로젝트 요구 사항에 따름
온도 범위	-200°C ~ +260°C (재료 종속)	응용 분야별
작동 압력	대기압 ~ 중간 압력 등급	설계 종속
자켓 연결	GL14, GL18 또는 사용자 정의 NPT/바브	고객 사양에 따름
실링 기술	통합 PTFE O링 및 가공 테이퍼	고성능 표준
포트 구성	밸브가 장착된 다중 공급/샘플링 포트	완전히 사용자 정의 가능
장착 옵션	벤치탑 스탠드 또는 통합 랙 마운트	맞춤형 설계
화학적 내성	모든 산, 염기 및 유기 용매	보편적 호환성